

SMART CLUSTER

MCT

特長

Features

3"から12"までの基板に対応、また基板以外のタイプでも対応可能
R & D プロセス装置用に最適な低コスト搬送機
ユニット方式の構成により短納期で対応

300mm基板搬送機として最小のフットプリント
必要十分な機能限定で簡単セットアップ・簡単操作
多様な用途に豊富なオプション設定（開発中）

ユーティリティの接続をするだけで即稼動可能なオールインワンタイプと、
プラットフォーム開発支援機として柔軟に対応可能なシンプルタイプの
2種類をご用意

Ready for wafers ranging from 3" to 12" in size, plus non-wafer items.

Low-cost transfer machine best suited for R&D process equipment

Unit architecture for short-time delivery

Minimum footprint available for a 300-mm-wafer transfer machine

Confined to a minimum set of necessary functions to ease both setups and operations

Broad selection of options available to meet many, diverse applications (under development)

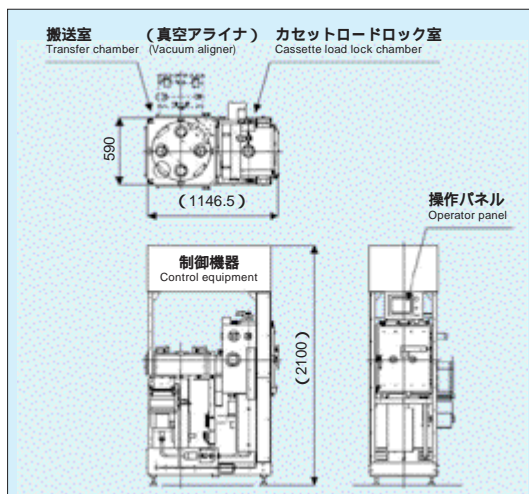
Available in two types: the all-in-one type, which can be commissioned into service instantly by simply hooking up utilities to it, and the simple type, which offers a flexible solution to the need for platform development support equipment.



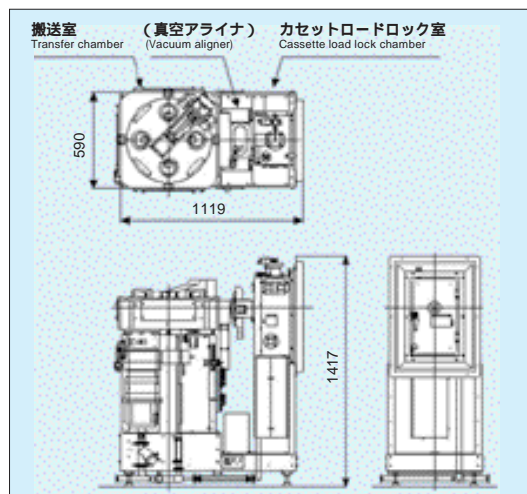
仕様

Specifications

オールインワンタイプ All-in-one type



シンプルタイプ Simple type



項目 Item	仕様 Specification
外形 Physical dimensions	600 ^W × 1100 ^D × 2100 ^H
搬送室 Transfer chamber	590 × 590 アルミ合金製 Alumi
到達真空圧力 Ultimate vacuum pressure	10 ⁻⁶ Pa台 On the order of 10 ⁻⁶ Pa
真空ロボット Vacuum robot	シングルハンド Single-hand スカラタイプ scalar type
真空シール Vacuum seal	磁性流体方式 Magnetic fluid type 真空隔壁DD方式 Vacuum partition DD
搬送リーチ Transfer reach (ゲート面から) (from the gate surface)	300mm (300wfs) 305mm (200wfs)
エレベータ Elevator	300用13枚カセット対応 300 13-wafer cassette-ready 200用25枚カセット対応 200 25-wafer cassette-ready
制御 Control	PLC + タッチパネル PLC + Touch panel
排気制御 Pumping control	自動シーケンス標準搭載 Automatic sequence control

項目 Item	仕様 Specification
外形 Physical dimensions	600 ^W × 1100 ^D × 1420 ^H
搬送室 Transfer chamber	590 × 590 アルミ合金製 Alumi
到達真空圧力 Ultimate vacuum pressure	10 ⁻⁶ Pa台 On the order of 10 ⁻⁶ Pa
真空ロボット Vacuum robot	シングルハンド Single-hand スカラタイプ scalar type
真空シール Vacuum seal	磁性流体方式 Magnetic fluid type 真空隔壁DD方式 Vacuum partition DD
搬送リーチ Transfer reach (ゲート面から) (from the gate surface)	345mm (3~6 wfs)
エレベータ Elevator	3~6 用25枚カセット対応 3-to-6" 25-wafer cassette-ready
制御 Control	ロボットコントローラ Robot controller エレベータコントローラ Elevator controller (アライナコントローラ) Aligner controller
排気制御 Pumping control	なし NA

本寸法・仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご使用の際にはご確認ください
標準品以外も製作しております。何なりとお問い合わせください。

* Dimensions and specifications are subject to change without notice. Please confirm before use.

* Nonstandard products are available. Please inquire about any other specifications.